PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-145319

(43) Date of publication of application: 06.06.1997

(51)Int.CI.

G01B 11/00 G01B 11/24 G06T 7/00

(21)Application number: 07-299921

(71)Applicant : MINOLTA CO LTD

(22)Date of filing:

17.11.1995 (72)

(72)Inventor: NORITA TOSHIO

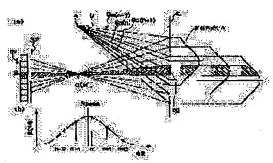
FUJII HIDEO

(54) METHOD AND EQUIPMENT FOR THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To ensure highly accurate high resolution three-dimensional measurement even when the reflectance of object is uneven and to realize high degree of freedom in the setting of measuring distance.

SOLUTION: The three-dimensional measuring equipment comprises means for scanning an object Q optically by projecting a detection light U, and an image pickup means for receiving the detection light U reflected on the object Q. While varying the irradiating direction θ a of detection light U toward the object Q, quantity of detection light U incident to a specified light receiving region (g) on an image pickup plane S2 is sampled periodically. Based on three or more sampling values, including a maximum sampling value and immediately preceding and following sampling values, an irradiation timing Npeak for maximizing the quantity of light is determined by interpolation. Subsequently, a part (ag) corresponding to the light receiving region (g) on the object Q is located based on the irradiating direction at that irradiation timing and the relationship between the light receiving region (g) and the incident direction of detection light.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(I2)公開特許公報(A)

တ 特開平9-14531

(11) 特許出顧公開番号

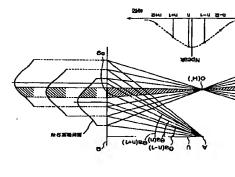
平成9年(1997)6月6日
(43)公開日

技術表示館所 11/00 H 11/24 K 15/62 4.1.5	(全16月)	ミノルタ株式会社 大阪商大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ピル 郷田 寿夫 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪町寮ビル ミノルタ株式会社内 大阪国際ピル ミノルタ株式会社内 編井 英郎 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号
F1 G01B 1 G06F 11	10	(71) 出額人 000006079 ドノルタ株 大阪国教 大阪国の 大阪国へ 大阪国の 大阪国へ 大阪国へ 大阪国へ 大阪国へ 大阪国へ 大阪 大阪日本 大阪日本 大阪国へ 大阪日本 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田
厅内路理卷舟	耐水項の数 2	J. 17. B.
成別配券 11/00 11/24 7/00	審查請求 未請求	特額平7-299921 平成7年(1995)11月17日
(51)Int. C1.* G01B 11 G06T 7		(22) 出曜日 (23) 出曜日

(54) 【発明の名称】 3 次元計削方法及び装置

【段四】 物体の反射率が不均一である場合にも高分解能 **か克格威の計割が可能であり、計劃阻艦の数仮の自由股** が大きい3次元計測を実現する。

【解決手段】検出光ひを照射して物体Qを光学的に走査 するための投光手段と、物体ので反射した検出光Uを受 光する機像手段とを用いる 3 次元計測に躱して、物体の に対する検出光Uの照射方向98を変化させながら、撮 **俊画S2内の特定の受光倒袋gに入射する検出光Uの光 量を固期的にサンプリングし、光虫のサンプリング値の** 最大値と、当該最大値を得たサンプリングの1つ前及び 1 つ後のサンプリングにおけるサンプリング値とを含む 3 少以上のサンプリング値に拠心で、、補間資好によっ て前記光量が最大となる照針タイミングNpoakを求 を、照射タイミングにおける照射方向及び受光領域&に め、物体の上の殳光倒板8に対応した部位88の位置 対する検出光の入針方向との関係に基づいて求める。



特許諸女の範囲

こめの投光手段と、前配物体で反射した前配検出光を受 【開水項1】検出光を照射して物体を光学的に走査する 化する姫像手段とを用いる3次元計削方法であって、

前配光量のサンプリング値の最大値と、当該最大値を得 竹記物体に対する前記検出光の照射方向を変化させなが ら、前記協像手段の協像両内の特定の母光倒域に入針す 8 柱野被田光の光曲や風越也にキンプリングし、

けるサンプリング値とを含む 3 つ以上のサンプリング値 **に描るいて、補間質算によって前配光虫が吸大となる照** トセンプリングの10柱及び10級のキングリングにな ドタイミングを求め、

竹記物体上の前記受光質域に対応した部位の位置を、前 **配照射タイミングにおける照射方向及び前配受光質域に** 対する前配検出光の入射方向との関係に基づいて求める

「請求項2】検出光を照射して物体を光学的に走査する ことを特徴とする3次元計測方法。

抑配物体に対する前配検出光の照射方向を変化させる走 複数の受光領域からなる損像面を有し、前配物体で反射 した前記検出光を受光する撮像手段と ための投光手段と、

前配各受光質域に入射する前配検出光の光盘を周期的に 出力するように前配扱像手段を駆動する提像制御手段 **在手段と、**

前配各受光質拡毎に、前記姫像手段が周期的に出力する 前配光盘の最大値と、当該最大値の出力タイミングの前

回及び次回に出力された前配光量とを含む3つ以上の光 **歯や、粒配吸大値の出力タイミングに対応がけて配値す** 析配配徴手段が配像する前配30以上の光曲に揺びい る配価手段と、

て、前配各受光領域の前配光量が最大となる照射タイミ ングを求める第10算年段と、

める第2頃算手段と、を有したことを特徴とする3次元 傾に対する前配検出光の入射方向との関係に基づいて来 前配照射タイミングにおける照射方向及び当該各受光観 前記物体上の前記各受光質域に対応した部位の位置を、 干型装配

[発明の詳細な説明]

0001

[発明の属する技術分野] 本発明は、物体にスリット光 又はスポット光を照射して物体形状を非接触で計測する 3 次元計測方法、及び3 次元計測装置に関する。 [0002]

基橡展L=L1+L2=2tanθa+2tanθp

[0008] 撮像倍率B=b/Z であるので、撥像面 S 2の中心と受光回数とのX 方向の距離を x p、 Y 方向 なお、受光角りpとは、点Pと主点Oとを結ぶ直接と、 受光軸を含む平面 (受光軸平面) とのなす角度である。

(e)

お配件9-145319

8

•

* [紀状の技術] フンジンレイングト原称される学協権型 であることから、CGシステムやCADシステムへのデ の3次元計創装置は、接触型に比べて高速の計測が可能 一ク入力、身体計劃、ロボットの視覚認識などに利用さ [0003] レンジファインダに好過な計倒方法として メリット光投敷符 (光砂矩符ともいう) が知られてい る。この方法は、物体を光学的に走査して3次元画像

(距離画像)を得る方法であり、特定の検出光を照射し 10 て物体を撮影する能動的計測方法の一種である。3次元 画像は、物体上の複数の部位の3次元位置を示す画報の 様合である。スリント光投影符では、梭出光として節固 が直線状のスリット光が用いられる。

ナるための図かもる。 中営な歌の物体のに形旧が描い株 状のスリット光Uを照射し、その反射光を例えば2次元 図、図16はスリット光投影法による計劃の原理を収明 [0004] 図15はスリント光投影符の戯取を示す **イメージセンサの勘像面S2に入針させる[図15**

部分に凹凸があれば、直線が曲がったり路段状になった りする [図15 (c)]。 つまり、計迦装置と物体Qと の距離の大小が掛像面 S 2 における反射光の入射位置に 反映する [図15 (d)]。スリント光Uをその幅方向 に臨向することにより、受光倒から見える範囲の物体表 面を走査して3次元位置をサンプリングすることができ る。 サンプリング 点数 ロイメージセンサの 画数数 冗女 存 (スリット画像) は直線になる [図15 (b)]。 照射 (a)]。物体Qの照射部分が平坦であれば、撮影像 ន

[0005] 図16において、投光の起点Aと受光系の レンズの主点のとを描ぶ基級AOが受光軸と垂直になる ように、牧光米と牧光米とが配置されている。牧光軸は 植像面S2に対して垂直である。 なお、レンズの主点と の、いわゆる像距離 (image distance) bだけ姫像面S 2から離れた安光軸上の点である。俊蹈艦16は、安光系 の紙点阻縮「とアント動数のためのフンズ登出し由との は、有限遠の被写体の像が撥像面52に紡像したとき ຂ

受光粒が2粒、拡換AOがY軸、スリット光の長さ方向 Z)を照射したときの投光軸と投光基準面(受光軸と平 [0006] 主点0を3次元直交座切系の原点とする。 40 がX軸である。スリット光Uが物体上の点P(X,Y, 行な投光面)との角度を9a、受光角を9pとすると、 和である。

点Pの樹樹2は(1)式で敷される。 [0007]

... (1) Z=L/(tan 8 a + tan 9 p)

の距離をypとすると (図16 (a) 参照)、点Pの座 標X, Yは、(2), (3) 式で敷される。

8/dx=X [6000]

8/d V= Y 08

Ŧ

角度98はスリット光Uの偏向の角速度によった一般的 に決まる。 受光角 B pはt a n B p = b/y p の関係か yp)を砌定することにより、そのときの角度りaに基 ら算出できる。つまり、撤像面S2上での位置(xp, dv.て点Pの3次元位置を求めることができる。

[0011]

: 2 = (L+Mtanθp) / (tanθa+tanθp) L=L1+L2=Ztanga+ (Z-M) tangp らなる類似年段を用いる母合には、計測の分解能が撮像 以上の原理のスリット光故影符による軒割において、例 えばCCDセンサのように損像面S2が有限個の画索か 年段の国業ピッチに依存する。 ただし、協僚面 S 2 上で のスリット光UのY方向(忠奎方向)の幅が複数画報分 となるようにスリット光Uを設定することにより、分解

により、最大強度位置(低心と呼ぶ)を画器ピッチ以下 [0012] 図17は従来の計測方法の原理を説明する の単位で阅定できることになる。補間資算は、各国禁の **受光量に正規分布をフィットさせるものである。 資算で** 水めた重心に基づいて座標Z, X, Yを求める。この手 法によれば、実際の分解能は1/8~1/10回茶程度 あれば、各國票8の受光盘に対する補間液算を行うこと ための図である。物体上の照射部分の反射率が均一であ るものと仮定すると、受光強度はソ方向に並がる正規分 布となる。この正規分布の有効強度範囲が複数画架分で

画案分とするには、投光の段階でスリット光Uの幅 (走 査方向の長さ)を拡げておけばよい。ただし、そうする と、物体の上でもスリント光UのY方向の幅が拡がるの で、照射部分(点P)が例えば物体色の境目である場合 【0013】 植俊固S2上でのスリット光Uの幅を模数 に、受光強度の分布が正規分布でなくなり、測定段差が

てフィルタなどによりスリット光口の幅を拡げて損像面 [0014] 従来では、物体の上でのスリット幅ができ るだけ細くなるように投光条件を設定し、受光系におい S2に入射させていた (特開平7ー174536号)。

Aから遠いほど、妙体Q上の既幹範囲(スリット幅)が [発明が解決しようとする課題] しかし、スリット光U の値を描くするのには光学的に段界がある。投光の起点 **打がる。したがった、粒米では、包存Qの反射母の分析** (計詢装置と物体Gとの距離) が短いという問題があっ に係わらず、所定の積度の計御が可能となる計測距離

[0016] 本発明は、物体の反射やが不均一である協 台にも均一である場合と同様に高分解能で高精度の計測 が可能であり、計測距離の設定の自由度が大きい3次元 計削装置を実現することを目的としている。

【課題を解決するための手段】 請求項1の発明の方法

20

*【0010】図16 (c) のように如光烁にメータワン 後側主点H,と前側主点Hとの距離をMとすると、点P ズ群を設けた場合には、主点Oは後側主点H'となる。 の座標2は (1B) 式で表される。

対する前配検出光の照射方向を変化させながら、前配撮 は、彼出光を照射して物体を光学的に走査するための投 光手段と、前配物体で反射した前配後出光を受光する撮 像年段とを用いる3次元計拠方法であって、前配物体に 像年段の協像面内の特定の受光領域に入射する前配検出 値とを含む3つ以上のサンプリング値に基づいて、補関 **資算によって前配光量が最大となる照射タイミングを求 书の光曲を困損的にキンプリングし、哲配光歯のキング** リング値の最大値と、当飲最大値を得たサンプリングの 1 し档及び1 し後のキンプリングにおけるサンプリング め、前配物体上の前配受光質域に対応した部位の位置 .. (1B)

語を取めることがらゆる。

を、前配照射タイミングにおける照射方向及び前配受光 徴なに対する前配検出光の入針方向との関係に基づいて 水める方法である。

と、複数の受光倒域からなる損像面を有し、前配物体で 反射した前配検出光を受光する損像手段と、前配物体に [0018] 請求項2の発明の3次元計測装置は、検出 前配各受光質域に入射する前配検出光の光量を周期的に 対する前記検出光の照射方向を変化させる走査手段と、 光を照射して動体を光学的に走査するための投光手段 出力するように前記姫像手段を駆動する損像制御手段

体上の前配名受光御城に対応した部位の位置を、前配照 と、前配各受光質域毎に、前配量像手段が周期的に出力 の前回及び次回に出力された前配光量とを含む3つ以上 の光量を、前配数大値の出力タイミングに対応づけて配 佐する記憶手段と、前記記憶手段が記憶する前記3つ以 上の光曲に払づいて、前配各受光徴塔の前配光曲が設大 となる照射タイミングを求める第1滾算手段と、前配物 **针タイミングにおける照外方向及び当該各受光質域に対** する哲的被出光の入社が向いの階級に基づいて来める群 する前記光量の最大値と、当該最大値の出力タイミング 2 位算手段とを有する。

[0019]

\$

ング)2と、3次元カメラ2の出力データを処理するホ [発明の実施の形版] 図1は本発明に係る計測システム 1の構成図である。計測システム1は、スリット光投影 甘によった女体料拠を行う3次にカメラ(アンジファイ ストヨとから権政されている。

プリング点の3次元位置を特定する計划データ(スリン ト画像データ)とともに、他体Qのカラー情報を示す2 **水元画像及びキャリプレーションに必要なデータを出力** [0020] 3改元カメラ2は、物体の上の複数のサン する。三角図量法を用いてサンプリング点の座標を求め

る演算処理はホスト3が担う。

たコンピュータシステムである。CPU3aには計劃デ 一夕処理のためのソフトウェアが組み込まれている。 ホ スト3と3枚元カメラ2との間では、オンタイン及び可 複型の記録メディア4によるオフラインの両方の形態の 光段気ディスク(MO)、ミニディスク(MD)、メモ [0021] ホスト3は、CPU3a、ディスプレイ3 b、キーポード3c、及びマウス3dなどから構成され **ゲータ受徴しが可能である。記録メディア4としては、** リカードなどがある。

向かう。スリット光Uの長さ方向M1の放射角度もは固 お、光学ユニットOUは、投光軸と受光軸との相対関係 [0022] 図2は3次元カメラ2の外観を示す図であ る。ハウジング20の前面に投光窓20a及び受光窓2 0 bが設けられている。投光窓20 aは受光窓20 bに 対して上側に位置する。 内部の光学ユニットOUが射出 は、投光窓208を通って計削対象の物体(被写体)に **受光窓20bを通って光学ユニットOUに入射する。な 庇かむる。包存の安面で反対したメリット光Uの一部が するスリット光(形広臨wの非状のレーヂアーム)U** を適正化するための2軸関整機構を備えている。

[0023] ヘケジング20の上海には、メーミングボ 液晶ディスプレイ21、カーソルボタン22、セレクト ボタン23、キャンセルボタン24、アナログ出力増予 31,32、デジタル出力端子33、及び配録メディア タン25a, 25b、手動フォーカシングボタン26 a,26b、及びシャッタポタン21が散けられてい る。図2(1)のように、ヘケジング20の背面には、 4の着脱口30aが設けられている。

[0024] 液晶ディスプレイ21 (LCD) は、磁作 最影者は背面の各ポタン21~24によった協勝ホード の設定を行うことができる。アナログ出力増子31から は計勘データが出力され、アナログ出力端子31 からは 画面の表示手段及び電子ファインダとして用いられる。 2次元画像信号が例えばNTSC形式で出力される。 ジタル田力緒子33は倒えばSCS1 結子である。

は、上述の光学ユニットOUを構成する投光側及び受光 ロック図である。図中の契線矢印は電気信号の流れを示 回の20の光学は40,50を有している。光学は40 においた、半導体レー炉(LD)41が射出する被長6 1のドライバ44、故光ワンズ然42の慰勧※45、及 ぴガルパノミラー43の駅動系46は、システムコント [0025] 図3は3次元カメラ2の機能構成を示すプ し、破線矢印は光の流れを示している。3次元カメラ2 70mmのフーナパーイは、故光フン火体42や追過ナ (売査手段) 43によった個向される。半導体レーザ4 ることによってスリット光ひとなり、ガルパノミラー ローラ61によって慰御される。

によって集光された光はピームスプリック52によって [0026] 光学桜50に拾いて、メームユニット51

針刻用のセンサ53に入射する。可視帯域の光は、モニ タ用のカラーセンサ54に入射する。センサ53及びカ 分光される。半導体レーザ41の路接板要帯板の光は、 ラーセンサ54は、どちらもCCDエリアセンサであ

時間平9-145319

がオートフォーカシング (AF) に利用される。AF機 る。メームユニット51は内盤型であり、入針光の一部 節は、AFセンサ5~とレンズコントローラ58とフォ **ーカシング駆動※59によって状現される。メーミング** 密制系60は知動メーミングのために数けられたであ。

され、又は記録メディア4に格赦される。計測データの オンライン出力には、アナログ出力強子31又はディジ 6 9からSCSIコントローラ66~喬琳され、ディジ れる。出力処理回路62によってセンサ53の各画菜毎 に対応する計劃ゲータが生成され、メモリ63,64に ると、針刻データは、SCSIコントローラ66又はN る扱像情報は、ドライバ56からのクロックに同期して 協僚信仰は、NTSC校校回路10及び7ナログ出力結 干32を掻てオンライン出力され、又はディジタル画像 タル田力組子33かのオンワイン出力され、又は計劃庁 【0021】 センサち3による勘線依然は、ドライベち 格柄される。その後、オペレータがゲータ出力を指示す TSC歿被回路85によった呼俗形式やオンテイン出力 タル出力焰子33が用いられる。カラーセンサ54によ カラー処理回路 6.7~転送される。カラー処理を受けた 生成街68で盘子化されてカラー画像メモリ69に格納 される。その後、カラー画像ゲータがカラー画像メモリ 5からのクロックに回旋して出力処理回路62~情况さ **ータと対応づけて記録メディア4に格割される。なお、** ន

の像であり、ホスト3側におけるアプリケーション処理 に際して参考情報として利用される。カラー情報を利用 する処理としては、例えばカメラ視点の異なる複数組の 計測データを組み合わせて3次元形状モデルを生成する 処理、3次元形状モデルの不要の頂点を間引く処理など カラー画像は、センサ53による距離画像と同一の画角 がある。システムコントローラ61は、キャラクタジェ ネレータ~1に対して、TCD21の回旧上に衝也な女 字や配号を表示するための指示を与える。

【0028】図4F技光フンメダ42の存成が示す権内 図である。図4 (a) は正面図であり、図4 (b) は倒 21、パリエータレンズ422、及びエキスパンダレン **メ42303007ンメかの権債かれたいる。非単存フ 一声41 5学刊つ牨フー声アー46 4つ 7 40 配序**か る。まず、コリメータレンズ421によってピームが甲 アンズ423によったピームがスリット最さ方向M1に 面図かめる。故光ワンズ殊42杆、コリメータワンズ4 行化される。次にメリエータレンズ422によってレー **ザアームのアーム包が関盟される。最後にエキスペンタ** 適切なスリット光口を得るための光学的処理が行われ

【0029】パリエータレンズ422は、撮影距離及び

ಬ

9

リット長を拡げることにより、偏向の後で行う場合に比 ペトスリット光Uの強みを低減することができる。 エキ スパンダレンズ423を投光レンズ系42の最終段に配 置することにより、すなわちガルパノミラー43に近づ 【0030】ガルパノミラー43による偏向の以前にス けることにより、ガルパノミラー43を小型化すること

から構成されている。 前側結像部515及び後側結像部 【0031】図5は受光のためのメームユニット51の **槙式図でもる。メームコニット51は、柜包括破割51** 5、パリエータ街514、コンペンセータ街513、フ オーカシング部512、後側結像部511、及び入射光 の一部をAFセンサ57に導くピームスプリッタ516 511は、光粒に対して固定である。

【0032】フォーカシング前512の移動はフォーカ ている。 ズーミング 慰勉及 60は、パリエータ 部514 メーミング励智炫60が描う。 レキーカシング励勉殊 5 母)を指し示すフォーカシングエンコーダ 5 9 Aを備え シング原電紙59が描い、パリエータ部514の移動は **の谷亀距ಡ(メーム紅み値)を指しボナメーミングエン** 9は、フォーカシング街512の移動距離(繰り出し コーダ60Aを個えている。

[0033] 図6はピームスプリッタ52の模式図、図 7は計削用のセンサ53の受光波長を示すグラフ、図8 はモニタ用のカラーセンサ 5 4 の受光故長を示すグラフ

ットフィルタ526、及びローパスフィルタ521,5 クロックミラー)521、色分解膜521を挟む2つの 26に設けられた赤外様カットフィルタ524、センサ プリズム522, 523、プリズム522の射出面52 プリズム523の射出面523bに散けられた赤外縁カ 【0034】ピームスプリッタち2は、色分解膜 (ダイ 53の粒面側に数けられた可視カットフィルタ525、 28から構成されている。

色分解膜521に入射する。半導体レーザ41の発板帯 て受光される。一方、色分解膜521を延過した光C0 ンナ53に向かって射出する。 ブリズム522から射出 梅の光口のは色分解版521で反射し、プリズム522 の入射面522aで反射した後、射出面522bからセ した光口のの内、赤外線カットフィルタ524及び可視 カットフィルタ525を登過した光がセンサ53によっ は、ローパスフィルタ527、プリズム522を泊って [0035] メームユニット51から入針した光UC

センサ54に向かって針出する。プリズム523から射 出した光C0の内、赤外袋カットフィルタ526及びロ は、プリズム523を通って射出面523bからカラー しパスフィルタ528や独追した光がカテーセンサ54 によって受光される。

[0036] 図1において、破壊で示されるように色分 解膜521は、スリット光の旋長(1:670mm)を 含む比較的に広範囲の夜長帯域の光を反射する。つま

遊覧する。

筑光の影響の小さい、すなわち光学的SN比が大きい計 り、色分解膜521の波長弧択性は、スリット光のみを 遊択的にセンサ53に入外させる上で不十分である。し かし、ピームスプリッタ52では、蝦換で示される特性 の赤外袋カットフィルタ524と、実袋で示される特性 で示される狭い衛囲の核長の光である。 これにより、蝦 敷鉢的にセンサ53に入針する光は、図りにおいて 斜線 の可視カットフィルタ525とが数けられているので、 剛を実現することができる。

【0031】一方、カラーセンサ54には、図8に実線 て、破骸で示される特性の色分解膜521を強通した赤 外帯域の光が遮断されるので、可視光のみが入射する。 で示される特性の訳外様カットフィルタ528によっ これにより、モニタ画像の色再現性が高まる。

側に散けてもよいし、逆に両方のフィルタをセンサ53 【0038】なお、歩外格カットフィルタ524及び可 現カットフィルタ525の2個のフィルタを用いる代わ イルタを用いてもよい。 赤外線カットフィルタ524及 び可視カットフィルタ525の両方をプリズム522の りに、赤外線及び可視光を遮断する特性をもつ1個のフ の側に設けてもよい。図6の例とは逆に、可視カットフ ィルタ525をプリズム522の側に設け、赤外線カッ トフィルタ524をセンサ53の側に散けてもよい。

【0039】図9は計測システム1における3次元位置 め、図15及び図16と対応する要葉には同一の符号を の算出の原理図である。同図では理解を容易にするた

る。具体的にはスリット光Uの幅を5回類分とする。ス 画珠ピッチ p v だけ移動するように、図9の上から下に **ナンプリング困逆毎にセンサ53かち1プァーム分の光** 【0040】センサ53の極像面S2上で複数画寮分と リット光Uは、サンプリング周期毎に撥像画S2上で1 向かって偏向され、それによって物体のが走査される。 なる比較的に幅の広いスリット光ひを物体のに照射す **電変換情報が出力される。**

ングにおいて有効な受光データが得られる。これら5回 分の受光ゲークに対する植間資算によって注目画群gが **にらむ範囲の物体変面 a g をスリット光Uの光軸が通過** するタイミング(時間重心Npeak:在日画黎gの受 **む査中に行うN回のサンプリングの内の5回のサンプリ** 【0041】 姫俊面S2の1つの画祭 Bに注目すると、 光量が最大となる時刻)を求める。図9(b)の例で

S

スリント光の照射方向と、注目画禁に対するスリット光 【0042】注目画業gの受光由は物体Qの反射率に依 存する。しかし、5回のサンプリングの各受光量の相対 は、n回目とその1つ粒の (n-1)回目の間のタイミ ングで受光量が最大である。求めたタイミングにおける を貸出する。これにより、複像画の画祭ピッチpvた規 の入気方向との脳承に枯んごと、後存のの位置(樹藤) 定される分解能より高い分解能の計測が可能となる。

内は受光の絶対歯に係わらず一庇である。 ひまり、勧体 色の微淡は計刻精度に影響しない。

を針刻データとしてホスト3に出力し、ホスト3が計划 [0043] 本実施形態の計測システム1では、3次元 カメラ2がセンサ53の画祭8年に5回分の受光ゲータ **ゲータに揺んいて物体のの扇殻を貸出する。 3次 ボガメ** ラ2の出力処理回路62(図3参照)は、各画案gに対 **応した計測データの生成を担う。**

変換個母を8 ピットの受光データに変換するAD変換部 最大となるフレーム番号(サンプリング番号)FNを配 【0044】図10は出力処理回路62のプロック図、図11はセンサ53の群出し範囲を示す図である。出力 処理回路62は、センサ53の出力する各画業gの光配 620、直列接税された4つのファームディレイメモリ 621~624、有効な5回分の受光データを配憶する ための5つのメモリパンク625A~E、受光ゲータが 歯するためのメモリパンク625F、コンパレータ62 及びメモリパンク625A~Fのアドレス指定などを行 (しまり、センサ53の在松画殊数) と回数の政光ゲー う図示しないメモリ制御手段から構成されている。各メ 6、フレーム番号FNを指し示すジェネレータ621、 モリパンク625A~Eは、針割のサンプリング点数 タを配信可能な容量をもつ。

一部のみを睨み出す手法は、特開平1-174536号 彼面S2の一部の有効型光関核(作状画像)Aeのみを 対象に行われる。有効受光質域Aoはスリット光Uの區 **向に伴ってフレーム毎に1画衆分だけシフトする。本映 栢形館では、有効受光倒核Aeのシフト方向の画架数は** 32に固定されている。CCDエリアセンサの撮影像の 【0045】4つのフレームディレイメモリ621~6 2 4 でデータ遊覧を行うことにより、個々の画繋8につ これもファーム分の政治ゲータを回降にメモリパンク6 センサ53における1フレームの配出しは、被像画S2 の全体ではなく、高速化を図るために図11のように撮 25人~日に格納することが可能になっている。 なお、 公報に開示されている。

[0046] AD歿後前620は、17レーム年に32 ライン分の受光データD620を画業gの配列順にシリ アルに出力する。各フレームディレイメモリ621~6 24は、31 (=32-1) ライン分の容量をもつFI [0047] AD変換部620から出力された住目画案

S

624の出力が、メモリパンク625A~Eにそれぞれ gの受光データD620は、2フレーム分だけ避延され **部620の出力及び各ファームディレイメモリ621~** 格納され、メモリパンク625A~Eの配億内容が書換 が過去の最大値より大きい場合に、その時点のAD変換 モリパンク625Cに格納する受光ゲータ口620に対 **行母低か、コンベアータ626にれりた、メホリベング** 625Cが記憶する社目画味。 についての過去の免光ゲ →タD620の最大値と比較される。遅延された受光*9* **一夕D620(ファームディアイメキリ622の出力)** えられる。これと回時にメモリパンク625Fには、メ パしたファーム物中FNが格形される。

目のフレームのデータが格納され、メモリパンク625 [0048] すなむち、n毎目 (n<N) のフレームむ 在目画菜 g の受光虫が吸大になった場合には、メモリベ ンク625Aに(n+2)毎日のフレームのゲータが格 納され、メモリパンク625Bに(n + 1)番目のフレ ームのデータが格断され、メモリパンク625Cにn番 モリパンク625Eに(n-2)梅目のファームのゲー Dに(n-1)毎日のファームのゲータが格形され、ノ タが格納され、メモリバンク625Fにnが格納され ន

【0049】次に、3次元カメラ2及びホスト3の動作 **俊画S2におけるスリット長さ方向の画架数は231℃** ンプリング点数を200×231とする。すなわち、撮 を計画の手履と合わせて説明する。以下では、計画のサ もり、安質的なファーム数Nも200である。

【0050】ユーザー (超影響) は、LCD21が数示 するカラーモニタ像を見ながら、カメラ位置と向きとを グ操作を行う。 3 次元カメラ 2 ではカラーセンサ 6 4 に 対する数り閲覧は行われず、電子シャッタ機能により露 出制御されたカラーモニタ像が表示される。これは、紋 りを開放状態とすることによってセンサ53の入射光量 **決む、國角を散促する。その際、必要に応じたメーミン** をできるだけ多くするためである。 8

[0051] 図12は3次元カメラ2におけるゲータの を示す図、図14は光学系の各点と物体Qとの関係を示 崩れを示す図、図13はホスト3におけるゲータの流れ 十図である。

4の移動が行われる。また、フォーカシング部512の フォーカシングの過程でおおよその対物関距離doが適 **グ)に応じて、メームユニット51のパリエータ部51** 移動による手動又は自動のフォーカシングが行われる。 【0052】ユーザーによる画色鉛放磁布(メーミン **\$**

ない資質回路によった貸出され、貸出店来に拠んこれぐ **た、投光囱のパリエータレンズ422の移動由が図示し** 【0053】 いのような取光球のアンメ啓包に呼応し リオータフンズ422の移動態質が行むだる。

【0054】システムコントローラ61は、レンズコン

ε

年間 145319

トローラ58を介して、フォーカシングエンコーダ59 60人の出力(メーム紅み信「ヮ)を飲み込む。システ ムコントローラ 6 1の内部において、函曲収粕アーブル Aの出力(偽り出し毎m d)及びメーミングエンコータ

むした撮影条件データがホスト2へ出力される。ここで **補正係数 4 1, 4 2)、前側主点位置FH、及び像距離** bである。 粒回士点位置FHは、メームユニット51の の撮影条件ゲータは、強曲収益パラメータ(レンズ強み 前間構点Fと前側主点Hとの距離で表される。前側端点 Fは固定であるので、前側主点位置FHにより前側主点 T1、主点位置テーブルT2、及び後距離テーブルT3 が参照され、繰り出し由Ed及びメーム巡み値fpに対 Hが軽値することができる。

ザ41の出力(レーザ強度)及びスリット光Uの偏向条 る。この質定方法を詳しく説明する。まず、おおよその 対物間距離d。に平面物体が存在するものとして、セン サ53の中央で反射光を受光するように投射角設定を行 以下で説明するレーが強度の算定のためのパケス点 【0055】システムコントローラ61位、半導体レー 件(起臺開始角、走壺桥了角、偏向角速度)を算定す 灯は、この設定された投射角で行う。

[0056]次にフーが強度や対応する。フーが強度の 算定に際しては、人体を計測する場合があるので、安全 性に対する配慮が不可欠である。まず、最小強度LDm inでパルス点灯し、センサ53の出力を取り込む。取 り込んだ信号 [Son (LDmin)] と適正レベルS t y p との比を算出し、仮のレーザ強度LD1を設定す

[0057] LD1=LDminxStyp/MAX (Son (LDmin))

続いたフーが徴取LD1を再びパケス点だし、センサ5 ti. レーザ徴段LD1とMAX [Son (LD1)] と を用いた仮のフーが独取し口1を設定し、センサ53の 田力と適正レベルStypとを比較する。 センサ53の 出力が許容範囲内の値となるまで、レーザ強度の仮設定 3の出力を取り込む。取り込んだ信号 [Son (LD 1)] が適正レベルStyp又はそれに近い値であれ ば、LD1をレーザ強度LDsと決める。他の場合に

(例えば1/60秒) であり、実際の軒箇時における徴 と適否の確認とを繰り返す。なお、センサ53の出力の AFによる受動的な距離算出では、スリット光Uの受光 位置を高材度に推定することが難しいためである。セン 分時間より長い。このため、パルス点灯を行うことによ 取り込みは、投像面52の全面を対象に行う。これは、 サ53におけるCCDの積分時間は1フィールド時間 り、針刻時と毎価なセンサ出力を得る。

きのスリット光Uの受光位置から、三角測盘により対物 しては、対物間距離1の測距基準点である受光系の後側 を行うようにする。 走査開始角 t h 1、走査終了角 t h 【0058】次に、投射角と、レー护強度が決定したと に 基づいて、 臨向条件を算出する。 臨向条件の算定に際 主点H'と投光の起点AとのZ方向(図16参照)のオ フセットdoffを考慮する。また、走査方向の娼部に おいても中央部と同様の計測可能距離範囲d'を確保す るため、所定虫(例えば8画紫分)のオーパースキャン 閻距離dを決定する。最後に、決定された対物関距離d 2、個白角滋度のは、次式で敷される。

[0059] th1=tan-' [8×pv (np/2+ th2=tan-1 [- \(\beta\times\p\/2+8\) +L) 8) +L) / (d+doff)] ×180/x / (4+doff)] x180/m

ន

B:協僚倍略(=d/與効焦点距離freal) $\omega = (th1 - th2) / np$

DV:固株プッチ

np:撮像面S2のY方向の有効画雑数

へ送られる。按1は3次元カメラ2がホスト3へ送る主 このようにして算出された条件で次に本発光に移り、物 体Qの走査(スリット投影)が行われ、上述の出力処理 回路52によって毎6れた1回繋当たり5ノレーム分の 計捌データ(スリット画像データ)D62がホスト2〜 **送られる。同時に、臨向条件(臨向制御データ)及び七** ンサ53の仕様などを示す装置情報D10も、ホスト3 なデータをまとめたものである。 8

[0900]

€

2

中国平9-145319

	チークの代数	チーカレンジ
計画データ	インク F (71-18年)200×801×8bit インタ A (n + 2) 200×800×8bit インタ B (n + 1) 200×800×8bit インク C (n) 200×800×8bit インク B (n - 1) 200×800×8bit インク B (n - 2) 200×800×8bit	
女 秘 爾	像距離 b 的國共点位置 P.H スリット国内研究内医 to I 個向分泌度 v	0,000~200.000 0,00~300.00
湖 本 本	学賞の図業製(4ヶ75ヶ野 X、7 7回) 4 7 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1~0.00516~ 0.00~±90.00 0.00~±300.00 0.00~250.00
2次元面錄	R ブケーン 512×512 × 8bit G ブケーン 512×512 × 8bit B ブケーン 512×512 × 8bit	0~0 2888 2888 28888

 $*\Delta n = (-2 \times D (n-2) - D (n-1) + D (n+$ (i=n-2, n-1, n, n+1, n+2)1) +2×D (n+2)] /2D (i) ន メラ視線方程式の資算#33、スリット面方程式の資算 リット重心資算# 3 1、盈曲収整の補正資算# 3 2、カ #34、及び3次元位置資算#35が実行され、それに [0061] 図13のように、ホスト3においては、ス

よって200×231個のキンプリング点の3次元位間 (座標X, Y, Z) が算定される。サンプリング点はカ 以)とスリット面(サンプリング点を照射するスリット メラ視線(サンプリング点と後側主点H'とを結ぶ直

(D(n-1) - minD(i)] + (D(n+1) -

 $\Delta n = [-2 \times (D (n-2) - minD (i))$ minD (i)] +2x (D (n+2) -minD 50の受光ゲータの内の最小のゲータminD(i)を **益し引いて加重平均を求めることにより、環境光の影響** [0063] カメラ視線方組式は (4) 式及び (5) 式

(i)]] / ED (i)

を軽減することができる。

参照)は、各サンプリング時の曼光データD(i)を用 【0062】 スリット光Uの時間重心Npeak (図9 **ポロの光皙쩸) かの女点かむ。** いて (3) 式で与えられる。

*30 765. .. (3) Npeak=n+An

 $(u-u0) = (xp) = (b/pu) \times (X/(Z-FH)) \cdots (4)$ $(v-v\,0) = (y\,p) = (b/p\,v) \times (Y/(Z-FH)) \cdots (5)$

[0064] uO:撮像面における水平方向の中心画案位置 pu:類像面における水平方向の画繋ピッチ pv: 擬像面における無直方向の画類ピッチ u:投像面における水平方向の画寮位置 FH:前側主点位置 b: 做距離

v 0:協俊面における垂直方向の中心画類位置 v: 姫像面における垂直方向の画衆位置 スリント面方程式は (6) 式である。

特別平9-145319 sin(the2) -sin(thel+thed · nop) cos(thel+thed · nop) (g) ... the]: X輪周りの回転角 the2: Y軸周りの優き角 the3: Z軸周りの優き角 the4: X軸周りの角造形 nop: スリット過過時間=時間重心Npeak L: 基額長 . -sin(the2) 6 2-8cos (the + the 4 · nop) sin (the + the 4 · nop) -sin(the3) cos(the3) Y - L × cos(the3) sin(the3) 0-10

2 の3次関数で近似する。2次の補正係数を41、3次の [0065] 幾何収益は画角に依存する。 蛩はほぼ中心 画雑を中心として対象に生じる。したがって、強み重は 中心画珠からの胎盤の関数で表される。ここでは、距離 柏正係数をd2とする。柏正後の画衆位置n゚, v゚は (1) 式及び(8) 式で与えられる。

.. (2) (8) ∵ $v' = v + d \cdot 1 \times t \cdot 2^2 \times (v - v \cdot 0) / t \cdot 2$ u' =u+d1xt22 x (u-u0) /t2 +42×t2°×(v-v0)/t2 $t1 = (u - u0)^2 + (v - v0)^2$ +42×t2°×(u-u0)/t2 $t 2 = (t 1)^{-2}$ [0066]

的文誌D-II vol. J74-D-II No. 9 pp. 1227-1235, '91/9 **研究会資料 P R U91-113 [カメラの位置決めのいらない** 画像の幾何学的補正」小野寺・金谷、電子情報通信学会 [光学系の3次元キデルに基づく レンジファインダの転 精度キャリプレーション法] 植芝・吉見・大島、などに を代入し、vに代えてv'を代入することにより、蚕曲 お、キャリブレーションについては、電子情報通信学会 収益を考慮した3次元位置を求めることができる。 な 上述の (4) 式及び (5) 式において、uに代えてu 詳しい関示がある。

[0067] 上述の実施形態は、計測データD62に基 であるが、3次元カメラ2に3次元位置を算出する紋算 ル方式で算定することも可能である。受光側の光学系5 **ろいて3次元位置を算出する資質をホスト3が担うもの** 模能を設けてもよい。 3次元位置をルックアップテーブ 0において、メームユニット51に代えて交換レンズに たって植像笛邨を変更してもよい。

物体の反射率が不均一である場合にも均一である場合と [発明の効果] 請求項1及び請求項2の発明によれば、

同様に高分解能で高精度の計測が可能であり、計測距離 の設定の自由度が大きい3次元計測装置を提供すること がつきる。

[図面の簡単な説明]

【図1】本発明に係る計測システムの構成図である。

[図2] 3次元カメラの外観を示す図である。

【図3】3次元カメラの機能構成を示すプロック図であ

[図4] 投光レンズ系の構成を示す模式図である。

[図5] 受光のためのメームユニットの模式図である。

【図6】ピームスプリッタの模式図である。

【図7】 計測用のセンサの受光放長を示すグラフであ

[図8] モニタ用のカラーセンサの受光彼長を示すグラ

ಜ

【図9】 計測システムにおける3次元位置の算出の原理 フたある。

図である。

[図8]

[図7]

【図11】 センサの観出し範囲を示す図である。 【図10】出力処理回路のプロック図である。

[図12] 3次元カメラにおけるデータの流れを示す図

[図13] ホストにおけるデータの流れを示す図であ おおる。

[図14] 光学系の各点と物体との関係を示す図であ

\$

[図15] スリント光投影法の概要を示す図である。

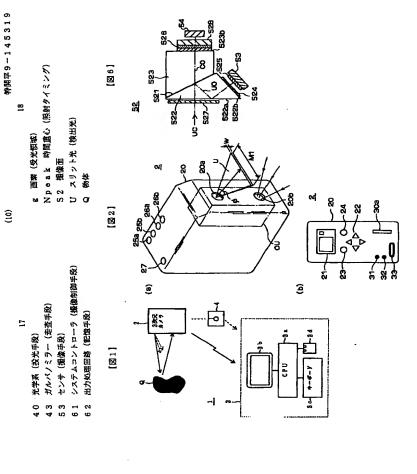
[図16] スリット光投影法による計測の原理を説明す

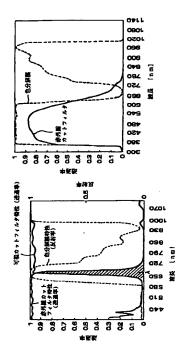
[図17] 従来の計測方法の原理を説明するための図で るための図である。

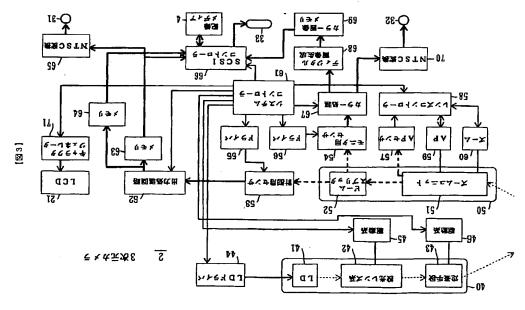
[符号の説明]

計測システム (3次元計測装置)

3 ホスト (資算手段) 23



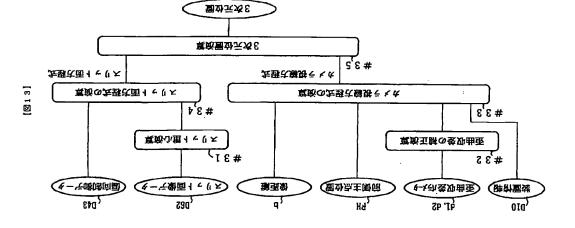




(11)

6.2 HANCENESS

(12)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.